

請求の範囲

- [請求項1] 本体フレームと、
 前記本体フレームに着脱可能に設けられるベースプレートと、前記
 ベースプレートに設けられた供給ノズルと、を有する、複数の棚モジ
 ュールと、
 供給源から供給されるパージガスが流通するメイン配管と、
 前記メイン配管に設けられると共に前記メイン配管から流路を分岐
 させる第一分岐部と、を備え、
 前記棚モジュールには、前記供給ノズルに供給する前記パージガス
 の流量を調整する流量制御装置が設けられており、
 前記第一分岐部には、流路を開閉する開閉バルブを介してモジュー
 ル配管が接続され、
 前記流量制御装置は、前記モジュール配管に接続されている、保管
 棚。
- [請求項2] 前記棚モジュールには、複数の前記供給ノズルと、複数の前記供給
 ノズルのそれぞれに対応する複数の前記流量制御装置とが設けられて
 おり、
 前記保管棚は、前記モジュール配管に設けられると共に前記モジュー
 ル配管から流路を分岐させる第二分岐部を更に備え、
 複数の前記流量制御装置のそれぞれは、前記第二分岐部を介して前
 記モジュール配管に接続されている、請求項1記載の保管棚。
- [請求項3] 前記モジュール配管及び／又は前記開閉バルブは、前記本体フレー
 ムに支持されている、請求項1又は2記載の保管棚。
- [請求項4] 前記本体フレームは、天井又は天井に固定された部材から吊り下げ
 られ、一方向に配列される吊り下げ部材であり、
 前記ベースプレートは、前記一方向に配列された前記本体フレーム
 に架け渡されており、
 前記モジュール配管及び／又は前記開閉バルブは、前記ベースプレ

ートとは異なる部材であって、前記一方向に配列された前記本体フレームに架け渡される跨ぎ部材に支持されている、請求項 1 ～ 3 の何れか一項記載の保管棚。

[請求項 5]

メインコントローラ又は電源に接続されているメイン配線と、
前記棚モジュールに設けられた前記流量制御装置又は前記供給ノズルに接続されたモジュール配線であって、容器を検出する検出センサに接続される前記モジュール配線と、

前記メイン配線に設けられており、前記メイン配線から電氣的に分岐させると共に、前記モジュール配線を着脱可能に接続する第三分岐部と、を更に備える、請求項 1 ～ 4 の何れか一項記載の保管棚。